

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17283-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 17.10.2022

Ausstellungsdatum: 17.10.2022

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

TASCON Gesellschaft für Oberflächen- und Materialcharakterisierung mbH
Mendelstraße 17, 48149 Münster

mit ihren Prüflaboratorien an den Standorten

Mendelstraße 17, 48149 Münster
Otto-von-Guericke-Ring 13, 65205 Wiesbaden Nordenstadt

Das Prüflaboratorium erfüllt die Mindestanforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, um die nachfolgend aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

physikalisch-chemische Analyse der chemischen, elementaren und molekularen Zusammensetzung von Oberflächen, Grenzflächen, oberflächennahen Schichten, komplexen Schichtsystemen, Spurenverunreinigungen und oberflächennahem Volumenmaterial einschließlich der Lateral- und Tiefenverteilung an Festkörpern, Querschnittsflächen, Pulvern, Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und Lacken mittels Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS) und Photoelektronenspektroskopie (XPS/ESCA); Bestimmung der Rauigkeit von Oberflächen mittels optischer Profilometrie

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17283-01-00

Innerhalb der mit ** gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Modifizierung sowie Weiterentwicklung von Prüfverfahren gestattet. Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft.

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Die Prüfverfahren sind mit den nachfolgend aufgeführten Symbolen der Standorte gekennzeichnet, an denen sie durchgeführt werden:

M = Münster

W = Wiesbaden

1 Bestimmung der chemischen, elementaren und molekularen Zusammensetzung von Oberflächen, Grenzflächen, oberflächennahen Schichten, komplexen Schichtsystemen, Spuren-verunreinigungen und oberflächennahem Volumenmaterial einschließlich der Lateral- und Tiefenverteilung an Festkörpern, Querschnittsflächen, Pulvern, Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und Lacken mittels Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS) und Photoelektronenspektroskopie (XPS/ESCA) **

1.1 Qualitative Analyse

VA-OG-AM-ToF-SIMS-Spektrenakquisition / Rev. 3 2017-02/ 3	Chemische Charakterisierung von Oberflächen mit der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS): Spektrometrie	M
VA-OG-AM-ToF-SIMS-Imageakquisition / Rev. 3 2017-02	Chemische Charakterisierung von Oberflächen mit der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS): Imaging	M
VA-OG-AM-ToF-SIMS-Tiefenprofilakquisition / Rev. 2 2017-02	Chemische Charakterisierung von Oberflächen mit der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS): Tiefenprofilierung	M

1.2 Quantitative Analyse

VA-OG-AB-ToF-SIMS- Quantifizierung-von-B-in-Si / Rev. 2 2017-02	Quantitativer Nachweis von Bor in Silizium (ToF-SIMS)	M
VA-OG-AB-XPS-Analyse- Spektroskopie, Rev. 4 2021-05	XPS-/ESCA-Analyse, Datenakquisition und - Auswertungen: Spektroskopie	M, W
VA-OG-AB-XPS-Analyse-Imaging, Rev. 2 2021-05	XPS- / ESCA- Analyse, Datenakquisition und - Auswertungen: Imaging	M, W
VA-OG-AB-XPS-Analyse- Tiefenprofilierung, Rev. 2 2021-05	XPS- / ESCA- Analyse, Datenakquisition und - Auswertungen: Tiefenprofilierung	M, W

2 Rauheitsmessung

DIN EN ISO 4287 2010-07	Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflächenbe- schaffenheit: Tastschnittverfahren - Benennungen, Defini- tionen und Kenngrößen der Oberflächenbeschaffenheit	M
----------------------------	--	---

verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
VA-...	Verfahrensanweisung für Hausverfahren der TASCON GmbH